

**마이크로파 소자 응용을 위한 $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-x}$ 고온초전도
박막의 제작과 특성분석**
(Fabrication and Characterization of $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-x}$ High
Temperature Superconducting Thin
Films for Microwave Device Applications)

한국전자통신연구소: 이상렬, 강광용

I. 서론

고온초전도 공진기, 필터, 안테나, 지연선 등과 같은 마이크로파 전송선소자 구현을 위한 고온초전도 박막제조에는 저유전상수를 갖는 기판이 필요하다. 이러한 용도에 매우 적합하고 저유전상수를 갖는 고온초전도 박막증착용 유전체 기판에는 MgO , LaAlO_3 , Al_2O_3 등이 있다. 이들 중 MgO 기판($\epsilon=9.6$)은 유전상수가 LaAlO_3 ($\epsilon=24$)에 비해 낮으며, Al_2O_3 와는 달리 $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-x}$ (YBCO)와 어떠한 화학적 반응도 증착 중에는 일으키지 않는다. 그러나 MgO 기판 위에 재현성 있는 고온초전도 박막을 성장시키기에는 기판의 흡습성(hygroscopic) 때문에 용이하지 않다. 따라서 마이크로파 전송선 소자응용을 위한 MgO 기판 상에 양질의 에피택셜박막을 제조하기 위한 최적증착조건을 추출하는 공정개발이 매우 중요하다.

II. 실험방법

본 연구에서는 펄스레이저 증착법을 사용하여 $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-x}$ (YBCO) 고온초전도 박막을 (100) MgO 기판 위에 성장시키고, 물성측정(전자기특성 및 표면특성)을 통하여 최적증착조건을 추출하였다. 추출된 공정변수를 기초로 하여 에피택셜 YBCO 고온초전도 박막을 제조하고, 이를 이용하여 고온초전도 마이크로파 공진기를 제작하여 양호도(Q-factor)를 측정하였다. 본 실험에서는 펄스레이저 증착법의 기판온도, 산소분압, 타깃-기판간의 거리, 레이저 에너지, 플룸의 형태 등 여러가지 증착조건을 체계적으로 변화시키면서 마이크로파용 고온초전도 박막제조를 위한 최적조건을 추출하였다. 그림1(a)에서 알 수 있는 바와 같이 $1\text{J}/\text{cm}^2$ 의 에너지밀도와 4cm 의 타깃-기판간 거리와 750°C 의 기판온도 그리고 200mTorr 의 산소분압일 때, 85K 급의 임계온도값을 갖는 고온초전도 박막을 성장시켰으며 이러한 성장조건은 그림 1의 (b)에서 기판온도와 산소분압과의 관계에서 더욱 자세히 알 수 있다. 즉, 펄스레이저 증착법에서 생성되는 레이저 플룸의 테두리(가장자리)가 기판에 닿을 때의 증착조건인 200mTorr 산소분압과 $1\text{J}/\text{cm}^2$ 의 레이저 에너지밀도 하에서 기판의 온도가 어느 정도의 적정 증착조건 내에 있으면에서는 박막의 임계온도가 $85\sim 87\text{K}$ 의 값을 가짐을 알 수 있었다. 이러한 조건하에서 증착된 고온초전도 박막은 XRD, SEM, AFM, TEM 등을 이용하여 결정성 및 표면을 분석하였고, 임계온도는 4단자법과 SQUID를 이용하여 측정하고 비교하였다. 레이저 증착법으로 성장시킨 YBCO/ MgO 초전도박막의 T_c 는 $85\sim 87\text{K}$ 정도였으며, 양질의 박막으로 고온초전도 공진기를 제작한 후, 자체 설계.제작한 3-성분 치구(test-fixture)와 계측장비인 vector-network analyzer(HP 8510B)로써 77K 에서 공진특성을 측정하여 그림 2에 나타내었으며, 3dB 대역폭을 이용하여 계산한 결과, 높은 양호도($>10^3$)를 보여 주었다.

III. 결론

고온초전도 박막의 마이크로파 전송선소자 응용을 위하여, 저유전상수를 갖는 MgO 단결정 기판 위에 펄스레이저 증착법을 이용하여 $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-x}$ 초전도 박막을 증착하였다. 4 cm의 타깃-기판 거리하에서 200mTorr 산소분압과 $1\text{J}/\text{cm}^2$ 의 레이저 에너지밀도에서 770°C 의 기판온도를 유지시킬 때 임계온도가 가장 높은 박막이 성장되었으며, 증착되는 상태를 관찰해 보았을 때 우수한 증착조건은 레이저 플룸의 가장자리가 기판에 닿았을 때임을 알 수 있었다. 이러한 증착조건 하에서 제조된 고온초전도 에피박막을 이용하여 마이크로스트립 이중모드 공진기를 구현하고, 저온 마이크로파 응답특성을 살펴 본 결과, 77K에서 10^3 이상의 양호도(Q_v)를 갖는 양질의 에피택셜 박막임을 알 수 있었다.

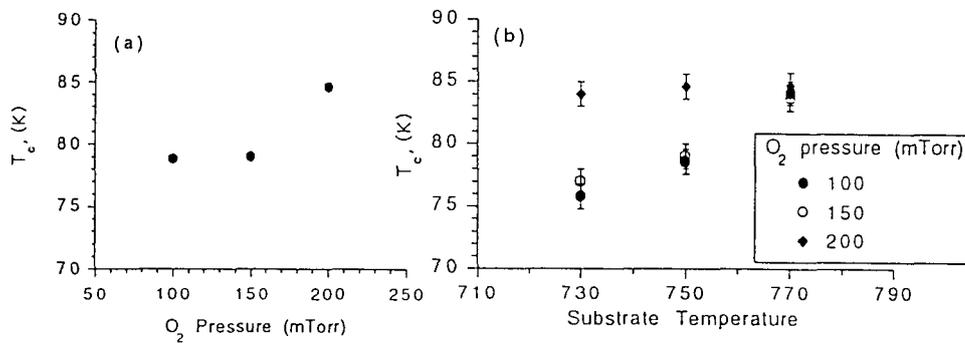


그림 1. (a) 기판온도 750°C , 타깃-기판간 거리 4cm, 레이저 에너지밀도 $1\text{J}/\text{cm}^2$ 로서 증착된 YBCO/MgO 초전도박막의 임계온도의 산소분압 의존성. (b) 다양한 산소분압과 기판온도의 변화에 따른 YBCO/MgO 박막의 임계온도와의 관계.

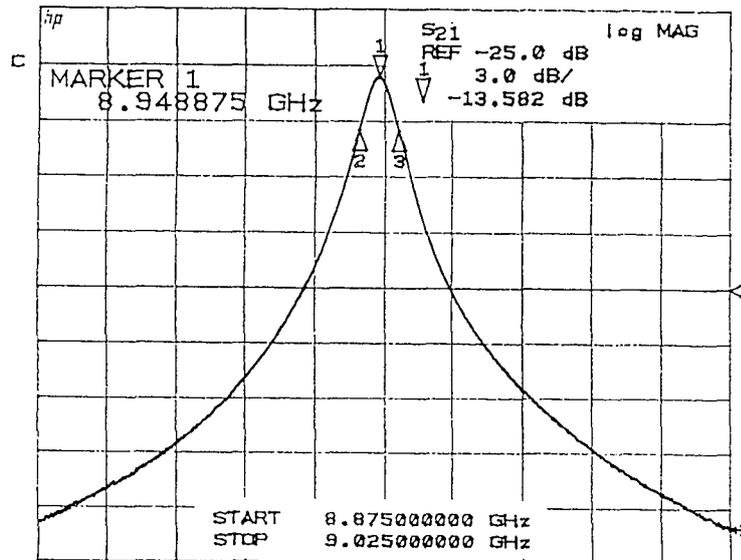


그림 2. 고온초전도 마이크로스트립 이중모드 공진기의 마이크로파 응답특성(77K).